

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2000-159511(P2000-159511A)

【公開日】平成12年6月13日(2000.6.13)

【出願番号】特願平10-329473

【国際特許分類第7版】

C 0 1 B 17/45

B 0 1 D 53/04

B 0 1 D 53/14

【F I】

C 0 1 B 17/45 G

B 0 1 D 53/04 E

B 0 1 D 53/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月28日(2005.7.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 5】

図3の装置システムは、図2のものと同様であるが、ガス反応部3にはその内部の状況をモニタリングするためのインジケータ窓9を設けて処理操作の安全をはかっている。